OpenCV经典案例实战教程

贾志刚

内容

- 环境搭建与准备
- 学习基础与前提
- 课程内容介绍

OpenCV介绍

- 开源的计算机视觉框架
- 英特尔公司发起2006正式发布OpenCV1.0
- 当前最新的版本OpenCV4.8
- SDK support(Java、C++、Android、iOS)
- 开发者社区 www.opencv.org
- GITHUB https://github.com/opencv/opencv

开发环境搭建

- VS2017+OpenCV4.8 + Win10
- include目录配置
- 库目录配置
- 链接配置
- 环境变量重启VS2017

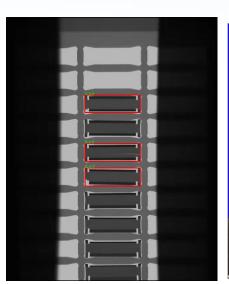
学习前提与基础

- 有比较好的OpenCV与C++基础
- 学习过《图像与视频分析实战教程》课程
- · 学习过《特征提取与DNN对象检测》课程
- 面向中高级开发者

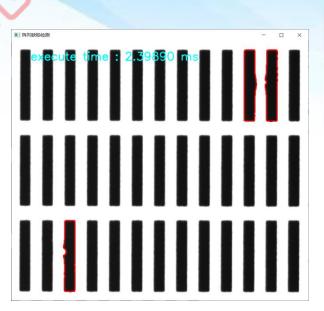
六个典型案例

- 刀片缺陷检测
- 自定义对象检测
- 实时二维码检测
- 图像分割与色彩提取
- 阵列缺陷检测
- DM喷码不良检测(歪斜、缺边、缺失)

运行截图





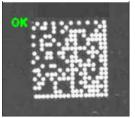


运行截图











开启OpenMP加速

- 轻松加速OpenCV运行
- 加速for循环
- 加速block代码段。

ANY QUESTION?

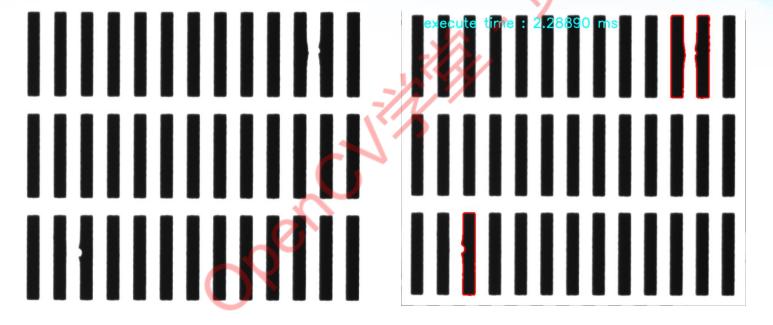


阵列缺陷检测

- 工程背景与需求
- 思路分析与相关知识点关联
- 代码实现与测试
- 加速OpenCV执行

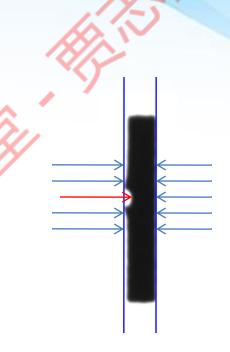
工业列阵图像的缺陷检测

• 检测列阵图像的两侧瑕疵



工业列阵图像的缺陷检测

- 检测思路,基于轮廓发现,根据外接矩形扫描 左右两侧边缘,得到左右脸侧边缘点
- 对边缘点排序, 计算最大间隔,
- · 根据阈值T,间隔大于T 为瑕疵,
- 阈值T可控



代码演示与解释

- 1. 扫描轮廓两侧边缘 提取全部边缘点
- 2. 按X维度大小升序 排序两侧边缘点, 计算最小与最大值 只差
- 3. 根据阈值完成过滤

需完成实验代码并提交 运行结果!

DM码喷印缺陷检查

- 工程背景与需求
- 思路分析与相关知识点关联
- 代码实现与测试
- 参数化文件与代码工程化封装

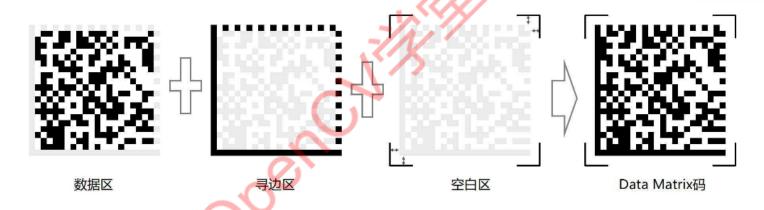
DM码喷印缺陷检查

• 某个工业品的表面DM码喷印缺陷如下



DM码喷印缺陷检查

- DM码特征解析与说明
- 规格从10×10 到144×144



基于寻边策略的DM码缺陷检查

- 先找两条边
- 然后再找数据区域
- 最后计算总的灰度均值

关键代码解释与测试

• 关键代码解释与测试

ANY QUESTION?

